

10 負圧環境下の O₂測定

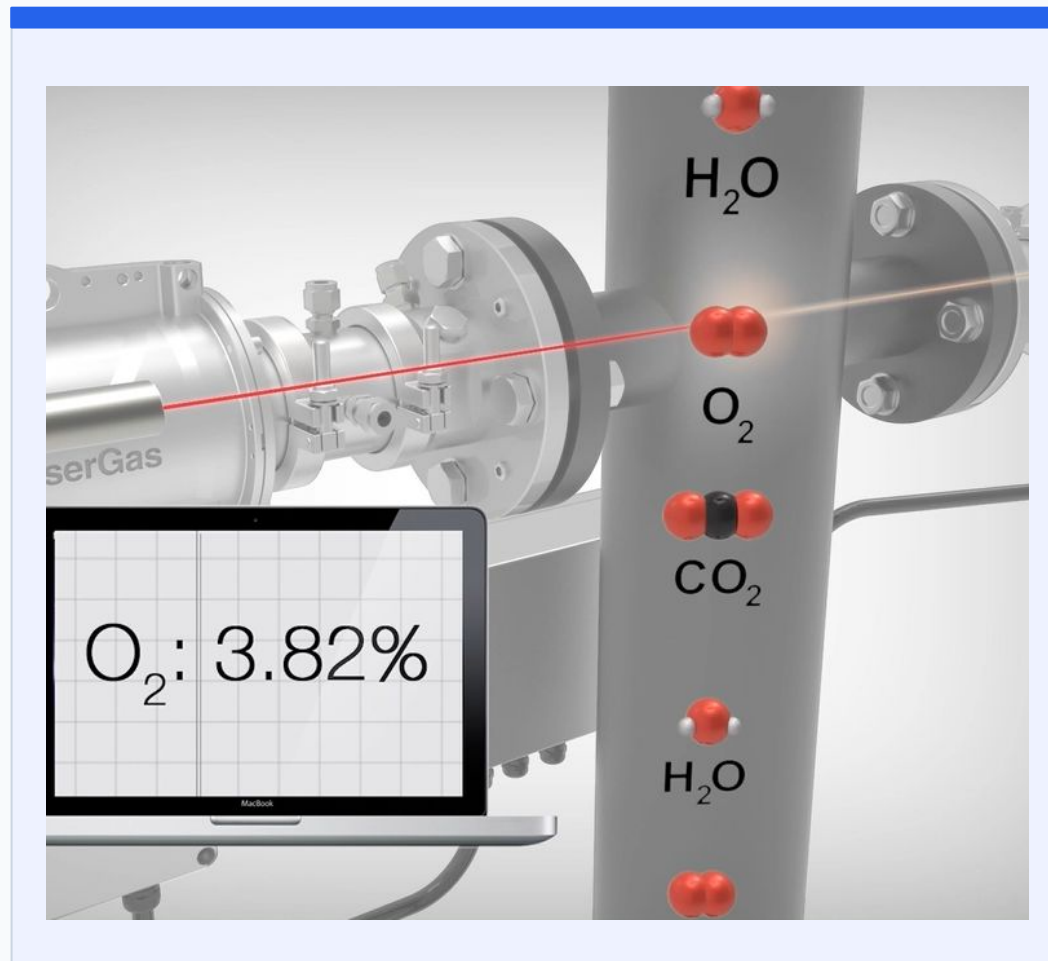
SPECIAL PROCESS

サンプリングが困難な環境でのプロセス監視

化学プラントの蒸留塔など、負圧(減圧)環境下でのプロセス監視は、従来のサンプリング(吸引)方式では多くの困難がありました。NEO Monitors社のレーザー式ガス濃度計のインライン方式が根本的に解決します。

従来の課題:

- 吸引トラブル: 負圧によりポンプ負荷増大、流量が不安定
- 外気リーク: サンプリングラインからの空気混入による誤差
- 腐食・毒性: 危険ガスをシステム外に引き出すリスク



10 負圧環境下の O₂測定



革新的ソリューション

サンプリング不要のインライン方式
負圧下でもガスを引かずに直接測定
腐食・毒性ガスへも非接触測定でセンサー劣化を完全排除



測定スペック

O₂下限検出: 100 ppm~
O₂以外のガス種も負圧下で測定可能

負圧環境でも安定したインライン計測を実現



導入ベネフィット

サンプリング方式と比較してメンテナンスの負担を大幅削減
品質管理と爆発防止を吸引の不確実性から解放
O₂以外のガス種も負圧下での測定が可能

キーワード: O₂下限検出: 100 ppm~ | 測定方式: TDLASインライン | 負圧環境対応 | 吸引ポンプ不要

▶ サンプリング不要のため、危険なガスをシステム外に出さない安全なシステムを構築できます